

Printer Cartridge용 저압대전체 개발

조 현 섭

청운대학교 디지털방송공학과

e-mail : chohs@chungwoon.ac.kr

A Development of Primary Charging Roller for Printer Cartridge

Hyun-Seob Cho

Dept of Digital Broadcast Engineering Chungwoon University

Abstract - Primary charging roller rotated with contacting surface of OPC drum and take charge OPC drum. Owing to this reason, primary charging roller made by elasticity substance with electric conduction. Properties of charging and image changed by class of coating, method of coating and environment. This study developed about coating material and coating method to make print image of good quality.

1. 서 론

Laser Beam Printer에서 화상형성 방법은 전자사진 방식을 이용한 것이며, 대전(Charging), 노광(Exposure), 현상(Development), 전사(Transfer), 정착(Fusing)의 과정을 통하여 이루어진다. 즉, 어두운 상태에서 감광체(OPC Drum)의 표면을 전체적으로 정전기적으로 대전시킨 다음, 적외선 영역의 광원에 의하여 화상 노광하면 Drum의 표면에 정전기적인 잠상이 형성된다. 그 잠상의 위에 음색의 미립자(Toner)를 근접시키면 정전기적인 인력에 의하여 Toner 입자가 흡인 부착되므로 화상이 보이게 되고, 이 Toner의 입자로 된 화상을 종이에 옮겨서, 그 Toner의 입자를 열융착시켜 영구화상을 얻게 되는 것이다.

Laser Beam Printer에서 화상형성을 위하여 감광체의 표면을 대전시켜야 하는데 종전에는 Corona Charging 방식이 사용되었으나, 4~10[kV] DC의 고압을 사용하기 때문에 인체에 유해한 Ozone이 발생 하는 문제가 있었다. 따라서 최근에 이 문제를 해결하기 위하여 개발된 기술이 접촉 대전 방식인데 이를 위하여 사용하는 것이 대전 Roller(Primary Charging Roller : PCR)이다.

즉 PCR은 OPC Drum의 표면과 접촉된 상태로

회전하면서 Drum의 표면을 대전시켜야 하므로 접촉이 잘 되도록 적당한 도전성을 갖는 탄성체로 만들어야하고, 또한 그 Roller의 표면은 Coating을 하게 되는데 Coating제의 종류나 Coating 방식에 따라서 대전특성이나 화상특성이 달라지게 되고, 또한 환경의 변화에 따라 화상특성이 달라지게 된다. 따라서 양질의 Print 화상을 얻을 수 있는 대전 Roller의 제조를 위하여 적합한 도전성 탄성체 Roller의 개발과 적합한 Coating제의 개발 및 적절한 Coating 방법의 개발을 하고자 한다.

2. 연구 개발 내용

2.1. 도전성 탄성체 롤러

2.1.1 배합의 균일화 방법

기존의 도전성 탄성체 Roller인 고무 Roller는 제조방법이 고상 배합 방법이다. 고상배합 방법은 입자들의 비중차이로 agglomerating에 의한 배합의 불균일성이 나타나게 되는 것은 불가피한 문제점이었다. 이와 같은 고상 배합 방법의 문제점을 해결하기 위한 방안으로서 액상 배합인 2액형 PU Casting 방법을 이용하여 저압 500V용의 Printer Cartridge용 도전성 탄성체 Roller(PCR)를 개발하였고, 제조공정은 그림 1에 나타내었다.

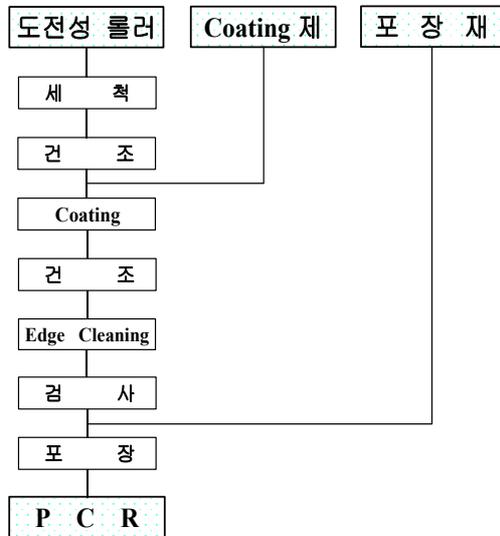


그림 1. 대전 롤러의 제조 공정

2.2. 도전성 롤러의 Spec. 제정

기존의 대전 Roller를 수집하여 도전성 Roller의 기계적, 전기적, 이화학적 등의 특성을 측정하였다. 실험한 결과를 분석하였고 분석한 그 결과를 근거로 하여 Roller의 Sample를 만들고 다시 그 Sample Roller의 제반 특성을 측정, 분석한 결과에 의하여 저압 500V용의 Printer Cartridge용 도전성 탄성체 Roller의 Specification을 제정하였고, Sample Roller는 그림 2에 나타내었다.



그림 2. 도전성 탄성체 Roller의 Sample

2.2.1. 재질

Shaft의 재질은 SUS 304 또는 그 동등이상의 Stainless Steel로 하고, Rubber는 천연고무, 합성고무 또는 합성수지 탄성체 등을 사용한다.

2.2.2. 이화학적 성능

(가) Hardness(HsA) : NN조건에서 롤러상태로 측정하여 40~50[°]이어야 한다.

(나) Resistance(Ohm) :

① 측정기는 SIMCO Japan INC. Work Surface Tester ST-3을 사용하여 NN 조건에서 3시간 이상 방치한 후 동일한 환경에서 측정한다.

② $5.0 \times 10^6 \sim 5.0 \times 10^7$ 이내이고 동일 Roller 내에서 저항의 편차는 없어야 한다.

③ 10[°C], 20[%RH] ~ 32[°C], 80[%RH]의 환경 변화에 대한 저항의 변화는 $10^{1.2}$ [Ω] 이내이어야 한다.

※ 시험 환경의 조건은 NN(23[°C], 55[%RH]), HH(32[°C], 80[%RH]), LL(10[°C], 20[%RH])에서 3시간 방치하고 동일 조건에서 측정한다.

(다) 고압시험 :

① 장치 : 정전압 DC 전원장치와 DC Micro Ampere Meter 및 Roller 회전장치로 구성하며 Roller 회전 장치는 [RPM]을 조정할 수 있는 직경 30[mm]의 금속 회전 롤러와 평행으로 시험할 롤러를 장착하여 700[g]의 힘으로 접촉시켜 금속 롤러에 따라서 회전할 수 있도록 제작한다.

② Bias Leak Test : 금속 롤러와 시험 견본 롤러 사이에 DC 500[V]를 정지 상태로 3초 동안 인가하여 절연 파괴로 인한 Leak가 없어야 한다.

③ 전류 측정 : 금속 롤러를 30[RPM]으로 회전시키면서 금속 롤러와 시험롤러 사이에 DC 500[V]를 인가하여 시험 롤러의 제3회전에 흐르는 전류치를 읽는다.

④ 저항 측정(HVR) : 측정방법은 ③과 같은 방법으로 하고 전류치로부터 저항치를 계산한다. (나)항의 저항치와 구분하기 위하여 HVR로 표시한다.

이러한 실험 장치는 그림 3에 나타내었다.



그림 3. Roller의 특성 시험장치

(라) Smoothness : 30배의 확대경으로 볼 때 표면에 이물질, 핀홀 또는 요철부분이 없이 평활해야 한다.

(마) Solvent Test : MEK 중에 5분간 침지후 외경의 변화가 0.5[mm]이내 일 것.

(바) Leaching Test : 밀봉한 상태로 20~25[°C]에서 20일 동안 OPC Drum과 PCR Roller를 1[kg]의 압력으로 접촉시켜 방치한 후 Drum의 표면에 Roller가 접촉되거나 또는 Drum의 표면에 균열이 생기지 않아야 하고, Toner 분말을 얇게 살포한 다음 가볍게 털면 Toner가 쉽게 떨어져야 한다.

(사) Heat Test : 120±2[°C]의 건조기에서 1시간 동안 방치한 후에 실온으로 방치 냉각한 후 저항, 치수, 경도 등의 변화나 다른 이상이 없어야 한다.

(아) 치수 측정 : Rubber의 외경과 회전시의 흔들림은 회전식 Laser Scan Micrometer를 사용하여 측정하며 흔들림은 0.08[mm]이내 이어야 하고, 금속부의 치수는 Vernier Caliper로 측정한다.

2.2. 도전성 롤러의 생산기술 개발

도전성 롤러의 제조시험을 통하여 Casting법에 의한 소형롤러 생산 가능성을 확인하였고, 또한 생산 기술상의 문제점 해결을 위한 연구를 하였다.

2.3. Coating제의 제조

2.3.1 Coating제의 배합표

Coating제의 종류	질 량	Coating제의 종류	질 량
Polymer	17.20g	OCA	9.03g
Solvent	173.00g	EBK	0.78g

2.3.2 제조 방법

70[°C]로 조절된 Water Bath 중에 설치한 1,000[ml]의 3구 Flask에 Solvent 173.00[g]을 넣고 Agitator와 Reflex Condenser를 설치한 다음 Agitator를 150~200[rpm]으로 돌리면서 Polymer 17.2[g]을 서서히 가하여 완전히 용해될 때까지 교반을 계속하고, 완전히 용해시킨다. 이렇게 용해된 액을 계속 교반하면서 EBK 0.78[g]을 서서히 첨가하여 교반을 약 2 시간동안 계속하여 용해한다.

다음 교반을 계속하면서 OCA(Organic Conductive Solvent) 0.78[g]을 첨가하여 약 30분 동안 교반을 계속하여 잘 혼합한 후 여과하고 냉각한다.

이렇게 냉각된 액에 Solvent를 추가하고 잘 혼합하여 원하는 점도가 되도록 조정하여 Coating제를 완성하고 밀폐·저장한다.

3. Coating Machine 개발 결과

3.1. Coating 시험 장치의 제작

Dip Coating 방식의 Coating 장치를 시험용으로 제작하였으며, 그 장치를 사용하여 Coating 시험을 실시하고, 시험용 롤러를 제조하였으며, 또한 생산용 Coating 설비의 제작을 위한 사양을 검토하였다.

3.1.1. Dipping 장치

(a) Dipping시의 이동 Stroke은 Pallet을 장착했을 때 롤러가 이동할 수 있는 거리로서 800[mm]이상이어야 한다.

(b) Dipping 속도는 하강과 상승의 구간을 임의로 구분하여 임의의 지정 속도로 지정한 구간을 정확하게 정속 이동할 수 있어야 하며 연속 작업 시에도 그 위치와 속도를 정확하게 유지하여 동작하여야 하고, 속도와 위치의 지정은 Servo Control Program으로서 설정과 변경이 용이하여야 한다. 또한 사용 빈도가 많은 5가지 Program은 외부의 Selector로서 선택 사용할 수 있도록 해야 한다.

(c) Coating 수량은 50개를 한 개의 Pallet에 꽂아서 한번에 할 수 있도록 하고 그 중량(최고 15[kg]정도)에서도 연속 작업에 이상이 없어야 한다.

(d) 이동이나 정지시 진동이나 소음이 발생하지 않아야 한다.

(e) 본 장치는 상기 Dipping 동작에 부가적으로 Coating을 위한 Pallet의 Loading 동작과 Coating후의 Unloading 동작이 자동으로 되도록 하여야 한다. 이 동작은 정확한 위치의 Loading Conveyor상에 있는 Pallet을 집어와서 Coating을 하고 Unloading Conveyor상에 정확하게 내려놓고 다시 Loading Conveyor상으로 이동하여 다음 Pallet을 집어오는 동작을 정확하게 반복 수행하도록 되어야 한다. 이를 위한 X방향의 이동 Stroke 실제 제작 시 Conveyor의 위치와 Pallet의 구조 등에 맞추어야 하고, 특히 Coating후의 Pallet을 이동하거나 내려 놓을 때 Roller가 흔들리지 않도록 Soft Start와 Soft Stop되도록 하여야 한다.

(f) 기계와 Tank의 설치 수직을 정확하게 맞추고 이동 동작도 수직과 수평을 정확하게 유지하도록 해야한다.

3.1.2. Tank Unit

(a) 구성은 Dipping Tank, Mixing Tank, Level Tank 및 액 온도 조절용의 온수 Heater와 순환배관

등의 System으로 되고 액은 Mixing Tank의 밑으로부터 Pump에 의하여 Level Tank의 상층에 올려지는데 Pump와 Level Tank의 밑으로부터 Dipping Tank의 밑으로 낙차에 의하여 자연 공급되도록 배관한다. Dipping Tank에서는 항상 일정한 Level을 유지하고 Overflow는 Mixing Tank로 Return 하도록 배관한다.

(b) 각 Tank의 구조와 치수는 별도의 협의로 결정한다.

(c) 점액부는 재질을 SUS 304로 하고 Pump는 Air Diaphragm Pump를 사용하며 Pump의 Frame은 Al이나 SUS로 하고, Diaphragm은 Teflon과 EPDM 접착품을 사용한다. 액의 토출량은 18[l/min]정도로 한다.

(d) 배관은 Sanitary 배관으로 하고 Clamp의 Packing은 Silicone을 사용한다.

(e) 배관시 Dipping Tank에는 Pump로부터 진동이 전달되지 않도록 Flexible Hose를 사용한다.

(f) Tank와 배관의 모든 점액부는 매끄럽게 전해 연마나 Buffing 처리할 것.

(g) 배관은 분해와 청소가 용이하도록 하고 분해시 필요한 부분에는 Valve를 설치한다.

(h) Filter는 100mesh와 150mesh의 SUS mesh를 사용하고 Filter의 Housing 상부에는 Air Vent와 Valve 및 Pressure gage를 설치한다.

(i) Dipping Tank와 Mixing Tank는 온수를 순환시킬 수 있도록 Jacket구조로서 수압시험을 한 다음 설치 배관하여야 한다.

(j) Unit를 Compact하게 일체형으로 대차 위에 조립하여 배관하고 Unit로서 교환이 용이하도록 바퀴를 설치하고 온수 배관과 공압 배관과 전선 배선을 적합한 Coupling으로 연결하도록 한다. 이때 각 Tank의 위치와 Level은 지정하는 바에 따라야 한다.

(k) 각 Tank는 뚜껑의 기밀이 잘되도록 하여야 하며 Dipping Tank는 Coating시에만 열리도록 자동 개폐식 Shutter를 설치해야 한다.

(l) 액 온도의 조절은 온수의 온도조절과 온수의 순환 양 및 개폐를 자동으로 작동하는 방식으로 설정한 온도를 $\pm 1[^\circ\text{C}]$ 이내로 정확하게 유지하도록 하여야 한다.

(m) Mixing Tank에는 60~100[rpm]의 Agitator를 방폭형으로 설치하고 정밀한 점도계를 설치하여야 한다.

(n) Mixing Tank의 뚜껑은 반 이상이 열릴 수 있도록 하여야하고, Coating 부는 투명 Cover를 설치하고 출입할 수 있도록 Door를 설치하여야 하고 또한 천장에는 배기를 위한 Damper를 붙인 연통을 직경 100mm로 설치한다.

Coating 장치의 전체적인 구성은 대략 그림 4와 같다.

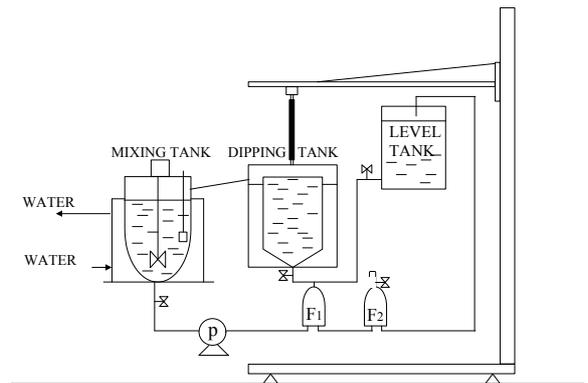


그림 4. Coating 장치의 전체적인 구성도

참고문헌

- [1] 미래 공학도도를 위한 재료과학, 교보문고, 2006, 8, 초판 4쇄
- [2] Howard Kaufman, Izhak Bar-Kana and Kenneth Sobel, "Direct Adaptive Control Algorithms, Springer-Verlag, 1994.
- [3] B. C. Kuo, Automatic Control Systems, Prentice-Hall, 1991
- [4] W. Reinhard et al., "CSCW Tools: Concepts and Architecture", IEEE Computer, Vol. 27, No. 5, pp.28-36, May, 1994.
- [5] LI Y.T. LAU C.C., "Development of Fuzzy Algorithms for Servo System", IEEE Control System Magazine, 65-70, April, 1989. ming", 1993
- [6] 방전·고전압공학, 동명사, 1991, 3
- [7] 전극계측기초, 동일출판사, 1995, 2